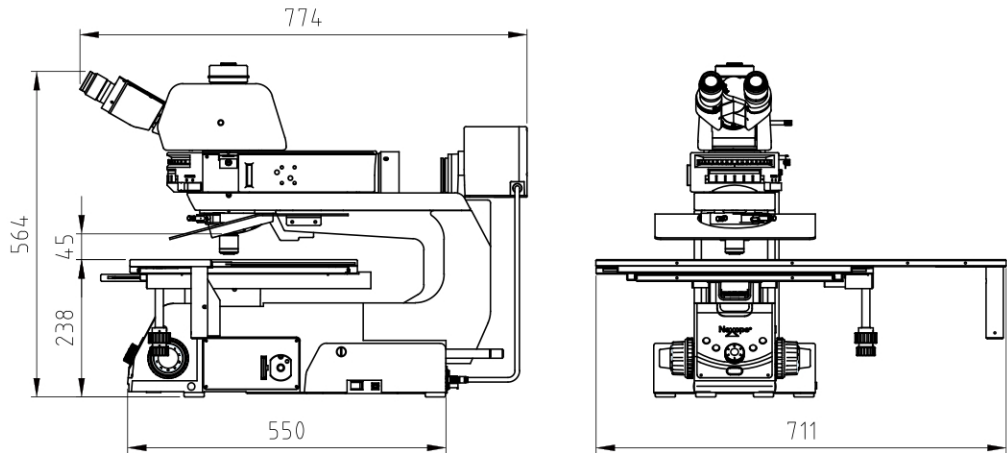


NX1000 系列工业检测显微镜配置表		
主体	光学系统	NIS45 无限远光学系统
	目镜	· SW10x(25) · SW10X(22) · EW12.5X(17.5) · WF15X(16) · WF20X(12)
	调焦系统	低手位同轴调焦机构 带高度限位环、粗动松紧调整环及左右微动手轮互换机构 调焦范围 32mm，微调格值 1um
	落射照明	12V，100W 卤素灯
	透射照明	LED-40A 冷光源
目镜筒		· 铰链式三目观察镜筒 目镜 / 端口：100/0、20/80、0/100 俯角：30 度，瞳距调整范围：47-78mm； · 人体工学铰链式三目观察镜筒 目镜 / 端口：100/0、20/80、0/100 俯角：0-30 度，瞳距调整范围：47-78mm
物镜转换器		电动六孔明暗场转换器，带 DIC 插槽
载物台		大平台 14" x 12"， 行程：356 x 305 mm (透射光可照明区域：356 x 284 mm) 可用于 300 毫米晶圆，附试样托架
聚光镜		透射照明配置聚光镜
观察方法	落射	明场，暗场，DIC，简易偏光，荧光
	透射	明场，简易偏光

尺寸图 DIMENSION FIGURE

(单位: mm)

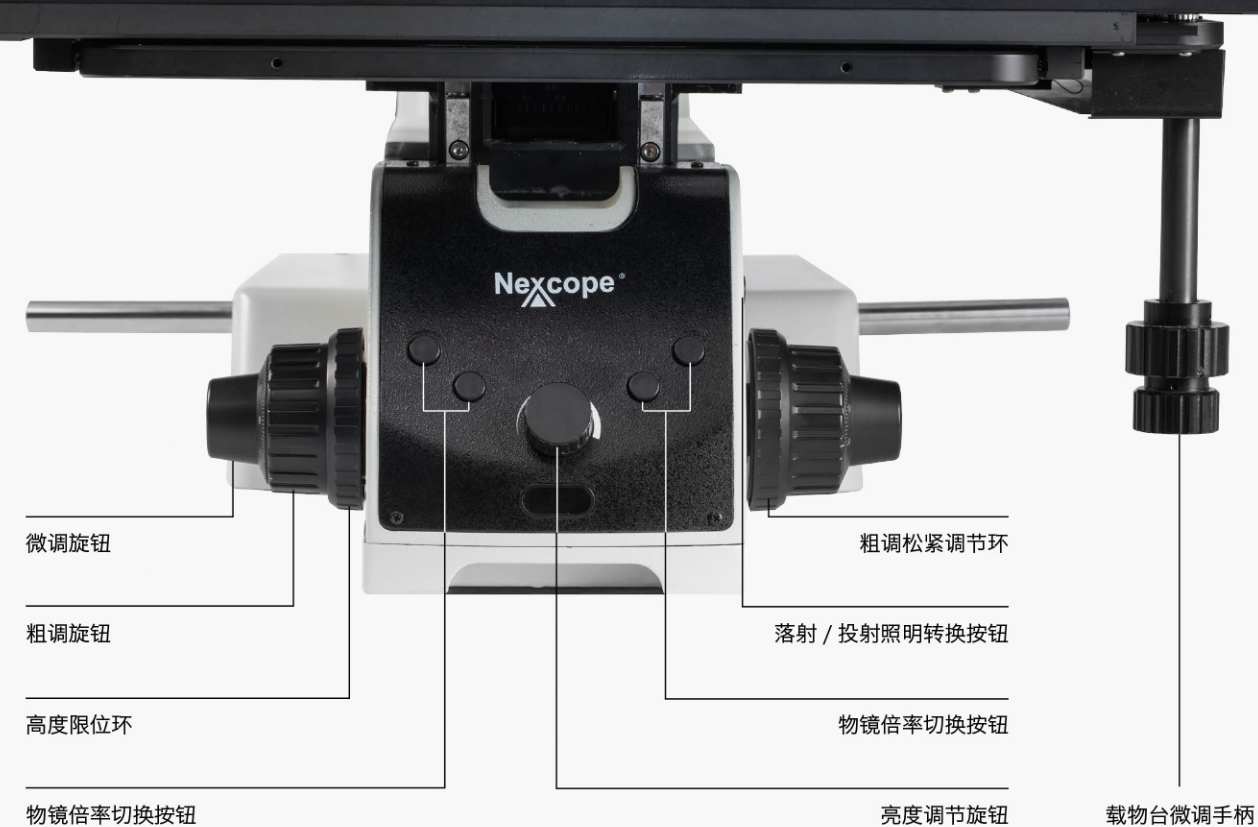


Nexcope®
Scientific research microscope

工 业 检 测 显 微 镜
NX1000 系 列
METALLURGICAL MICROSCOPE
FOR INDUSTRIAL INSPECTION

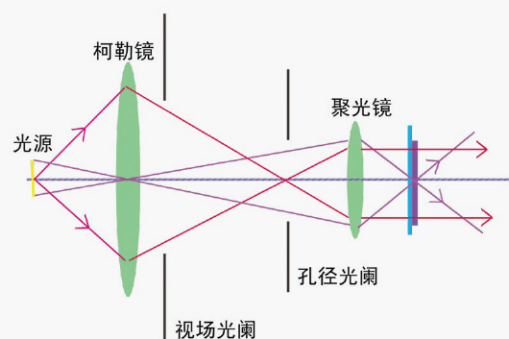


品味直观 渐入佳“镜”



显微操作面板位于显微镜正面

显微观察经常使用的控制机构位于显微镜正面（靠近操作者）。方便您观察样本时可以更快更方便的对显微镜进行操作。减少长时间观察带来的疲劳及大幅度动作带来的浮尘。



柯勒照明

完美的显微照明系统 -- 柯勒照明，提供明亮均匀的视场。配合无限远光学系统 NIS45 和高数值孔径和长工作距离的物镜，给您提供完美的显微成像。

NIS45 系列物镜

采用多层镀膜技术，能够补偿球差及从紫外到近红外的色差。保证了图像的锐度、清晰度和色彩还原性。使所有倍率都能获得高分辨率和平坦的图像。



可变倾角三目观察头

可调节倾斜角度的观察头，可以在更舒适的姿势下进行操作。最大限度的减少长时间工作带来的肌肉紧张与不适。

低手位调焦机构及平台微调机构

调焦机构及平台微调机构采用低手位设计，符合人机工程学设计，给予您最大程度的舒适感。

工业样本观察更方便

成像还原度高



内置离合器平台手柄

可实现载物平台的快速与慢速两种移动方式，能够对大面积样本进行快速定位。与平台微调手柄配合使用，使精确快捷定位样本不再困难。



内置控制面板

将特定按钮设定为与特定物镜产生对应关系，只需轻轻一按即可轻松改变放大倍率。

更适合 FPD 和 LSI 样本



超大载物平台

微电子及半导体样本往往面积较大，普通的金相显微镜平台不能满足它们的观察需求。NX1000 拥有超大的载物平台和超大的移动范围，并且移动方便快捷。是大面积工业样本显微观察的理想工具。



防静电保护罩

工业样本往往惧怕浮尘，些许浮尘就会影响产品品质及检验结果。NX000 拥有大面积的防静电保护罩，最大程度杜绝浮尘与落尘。保护样本，使检验结果更精确。

较长工作距离及高 NA 物镜

各种电子元件及半导体等使电路板样本有较大的高低落差。所以在此显微镜上采用拥有较长工作距离的专用物镜。同时为了满足工业样本对色彩还原度高要求，采用经过多年研发和改进，采用多层镀膜技术，具备高 NA 的复消色差物镜，还原样本真实色彩。



NIS45 物镜

普通显微物镜

模块化设计

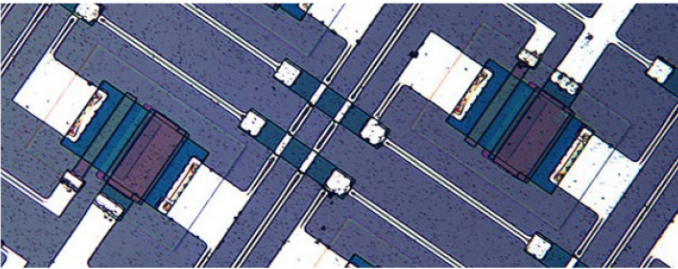
	明场	暗场	DIC	荧光	偏光
落射	O	O	O	O	O
透射	O	-	-	-	O

Nexcope 科研级显微镜通过模块化的组合， 能实现多种观察方式：明场、暗场、相衬、荧光、偏光、DIC 等。

多种观察方式， 满足各种检测需求

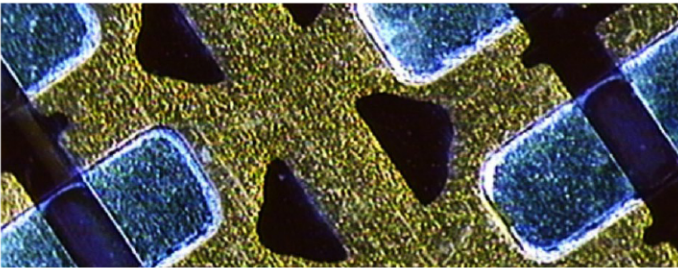
落射明场

NX1000 采用优秀的 NIS 无线远光学系统。视场均匀，明亮，色彩还原度高。适合观察半导体等不透明样本。



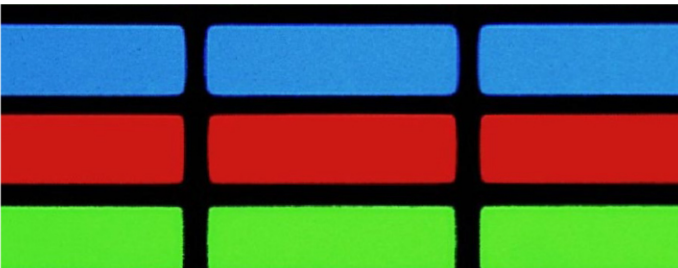
暗场

可实现明亮的暗场观察，可以对细小划痕等缺陷进行高灵敏度的检测。适合对高要求的样本进行的表面检测。



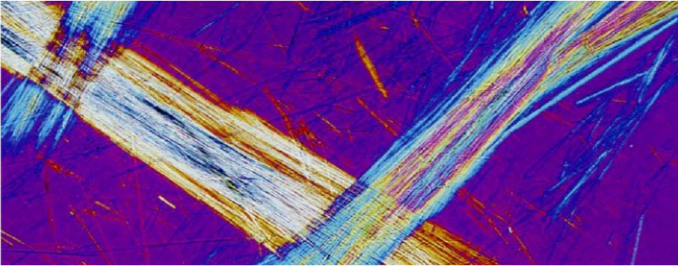
投射明场

对于透明的样本，如 FPD、光学元件等，可通过投射光聚光镜实现明场观察。同时也可搭配 DIC、简易偏光等附件使用。



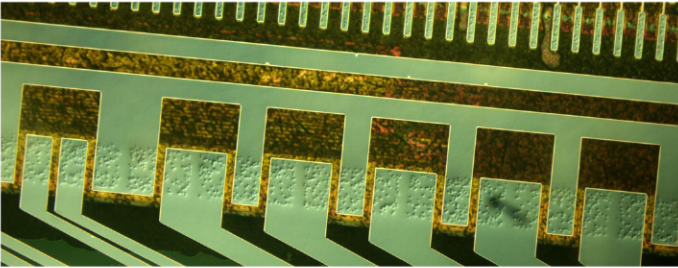
简易偏光

此观察方法适合具有双折射性质的标本，如金相组织、矿物、LCD 和半导体材料。



落射 DIC

用于观察精密模具中的细小差异。该观察技术可以将普通观察中无法看到的细微高度差异，用浮雕和三维图像的形式表达出来。



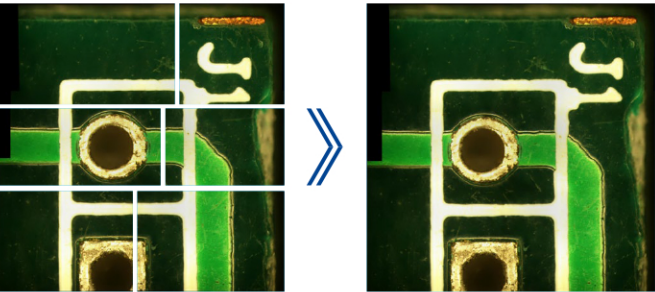
NOMIS Basic 图像处理系统

- 软件功能多样，满足您不同图像处理与分析需求。
- 多种摄像头可供选择，提供优质的显微拍摄方案。
- 通用 USB3.0 接口，可提供高速的图像传输。

高质量图像获取、处理和分析的成像软件

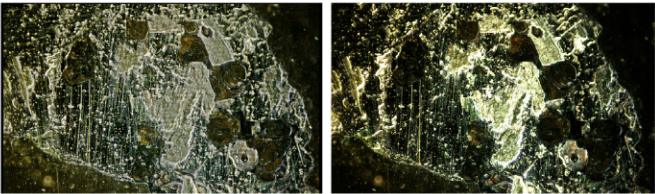
图像拼接

NOMIS Basic 通过实时采集图像或导入图像，可以快速将小幅图像进行拼接，形成一幅大尺寸、高分辨率的图像。



高清实时 HDR 图像 / 视频

当观测不同的样本时，样本表面会显示出高对比度的区域。HDR 使用户在点击之间完成完美曝光图像的生成。



可根据观察需求选择摄像头



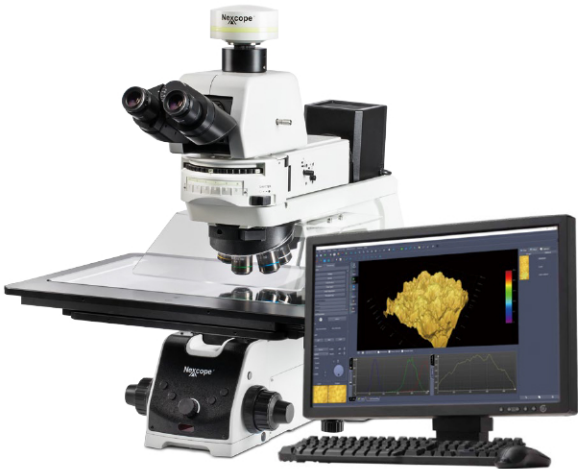
高分辨率制冷彩色摄像头
TC6CCD
1 英寸 600 万像素 CCD



高分辨率彩色摄像头
T6CCD
1 英寸 600 万像素 CCD

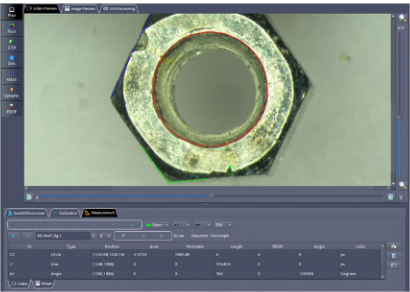


高速彩色摄像头
T16
4/3 英寸 1600 万像素 CMOS



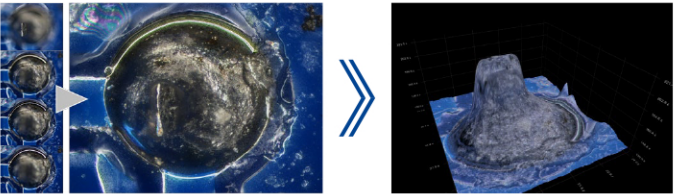
实时 / 静态测量

典型观测和质量控制需要交互式的测量功能，例如：距离，角度，矩形，圆形和椭圆。



景深融合 /3D 重建

NOMIS Basic 提供景深融合和 3D 重建功能。



系统图解

用于 Nexcope NX1000 系列显微镜

